高出力 GaN ダイオード励起 Pr: LiYF₄赤色レーザ

A High Power GaN Diode-pumped Pr: LiYF₄ Red Laser

橋本浩平(D3)

K.Hashimoto

Abstract

A CW Pr:LiYF₄ laser at 639 nm pumped by a high power GaN laser diode (444 nm) was demonstrated. The highest laser power of 94 mW was achieved with the optical-optical conversion efficiency of 35 %. Characteristics of this laser at elevated temperatures were also investigated for practical applications such as a laser projector.

1 はじめに

近年,可視光レーザはディスプレイ,銀塩写真のプ リント,バイオイメージングの分野を中心に注目を集 めている.特に,プロジェクションディスプレイの分 野はコンシューマ向けということもあり,高出力,高 安定性はもちろんのこと,高効率で安価ということも 求められる.赤色の領域では,AllnGaP系の半導体レ ーザが室温でCW発振しているが,熱に弱いため高温 下での動作や高出力化に難がある[1].半導体レーザ励 起固体レーザでは,高ビーム品質で高出力化が可能で あるが,可視光のものは赤外レーザの2倍波[1]もしく は多段励起[3]によるものであり効率があまり良くな い.

3 価のプラセオジウムイオン (Pr^{3+}) をドープした材 料は青,緑,オレンジ,赤といった可視光で直接レー ザ発振可能であり,440nm 帯で励起可能であるため GaN系の半導体レーザを励起源に使用することができ, 高効率が期待できる.また,GaN系の材料は高温下で の動作に優れており丈夫であり,また現状ですでに比 較的高出力なものがあり,今後もさらに高出力化が進 んでいくと考えられる.現在,レーザ発振が確認され ている Pr^{3+} ドープ材料には,LiYF₄[5-8], BaY₂F₈[6], YAG[9], YAIO₃[10] といった結晶やフッ化物ファイバ [11-13]があるが,常温で高効率な CW 動作が報告され ているのは、フッ化物系の材料だけである.酸化物系の材料では、常温においては非輻射遷移が大きくレー ザ発振を妨げているからである.近年、442nmのGaN 系半導体レーザを励起源とした Pr³⁺:LiYF4 レーザが赤 色での発振に成功されているが[5]、励起の波長が吸収 のピーク波長である 444nm からわずかにずれており、 その最大励起出力が数 10mW程度であるために、最大 1.5mWの赤色レーザ出力と、24%のスロープ効率しか 得られていない.Arイオンレーザ[4]や光励起半導体レ ーザの2倍波[7]での励起で発振している報告もある が、それらも吸収のピーク波長と完全に一致していな いため、高濃度ドープで長い結晶が必要となっている. また、Pr³⁺ドープ材料は、数 at.%のドープでも濃度消 光が起こるため高濃度のドープは好ましくない[5].

本研究では、高出力な 440nm 帯の半導体レーザを励 起源とした Pr³⁺:LiYF₄ レーザを報告する.また、レー ザディスプレイ等の分野では高温下での動作が要求さ れ、さらなる高出力化のためには温度特性が重要であ るため、高温下でのレーザ特性や、発光スペクトルや 蛍光寿命といった分光学的特性も測定した.

2 実験

本研究では、長さ 4mm, Pr^{3+} を 0.5at.%ドープした LiYF₄結晶を使用した.この結晶は c 軸と平行にカッ トされており、両サイドには AR コートを施した.レ ーザ発振実験及び蛍光強度の観測には、日亜化学製の GaN 系半導体レーザを使用し、その電源には旭データ システムズ社製の温度コントローラ付きのもの (ALP-7033CA)を使用した.この半導体レーザは 444nm 付近で発振し、最大出力は 500mW (I_{op} =550mA) であ る.蛍光寿命の測定には、Q-スイッチ Nd:YAG レーザ の 3 倍波 (パルス幅 3ns、繰り返し周波数 10Hz) で励 起した光パラメトリック発振器を使用した.また、蛍 光計測には相馬光学製の CCD タイプの分光計(S-2600, 分解能 2.0nm) を使っている.

レーザ発振実験では、Fig. 1 に示すように、まず、 半導体レーザ光を、焦点距離 4.6mm の非球面レンズで 平行光線にし、シリンドリカル凹レンズ・凸レンズ対 にてできるだけ真円ビームになるようにした. レンズ 対では、同時に半導体レーザの非点収差の補正も同時 に行っている. コリメートされたビームは、焦点距離 50mm のレンズにて共振器内の Pr:LiYF4 結晶内に集光 し、 π 偏向で励起した. レーザ共振器は、平面のダイ クロイックミラーと凹面の出力ミラーで構成し、出力 ミラーには、反射率が 99%、98%、96%の 3 種類を用 いた.



Fig. 1 Schematic of Pr:LiYF₄ laser oscillation experiment

3 実験結果

Fig. 2は、出力ミラーの反射率を 99%、 98%、 96% としたときの,吸収パワーに対する,赤色レーザ光 (639nm, ³P₀-³F₂, σ偏光)の出力である.この結晶では, 励起源の半導体レーザの電流が 460mA 以下の時は 90%以上の励起光を吸収した. LD のケースが 20℃の 時, その駆動電流を 130mA から 460mA に増加させる と、その中心波長は 442.9nm から 444.2nm に変化して いた. 出力ミラーの反射率が 99%, 98%, 96%の時の 発振信閾値は、それぞれ7mW、13mW、22mWであり、 出力ミラーの反射率が 96%の時に, 266mW の吸収パワ ーに対し最大94mWの光出力を得ることが出来,その 光-光変換効率は35%であった.また、この結果より共 振器内部の損失は0.7%程度と見積もらた.よって、こ の共振器でのスロープ効率の限界は45%,量子効率は 65%であると考えられる.なお,原子量子効率 $(hv_{\rm L}/hv_{\rm P})$ は 69%である.



Fig. 2 Plots of the output power at 639 nm as a function of absorbed pump power for various output couplers.

Fig. 3 は出力ミラーを 99%とし, Pr:LiYF4 結晶を 300K から 380K まで加熱したときのレーザ出力の結 果である. 高温下でのレーザ発振実験では結晶を加熱 するため, 隣接する入力ミラーにダメージが入る恐れ がある. そのため,入力ミラーから Pr:LiYF4 結晶を数 mm 程度離さなければならず,発振効率はわずかに減 少する. 結晶の温度が 300 K, 350 K, 380 K の発振閾 値はそれぞれ 9 mW, 17 mW, 22 mW であり, 380K では 閾値が常温の 2 倍以上になっていた. しかし,加熱す ることによるスロープ効率の悪化は観測されなかった.



Fig. 3 Output power at 639 nm as a function of absorbed pump power for various crystal temperatures with a 99 % output coupler.

Fig. 4 は、300K と 380K における、 π 偏向および σ 偏向の蛍光スペクトルである. π 偏向の 522 nm $({}^{3}P_{1} - {}^{3}H_{5})$ の蛍光を除いては、加熱することで蛍光強度が著しく弱くなることが確認された. Pr^{3+} イオンの蛍光は、ほとんどが ${}^{3}P_{0}$ レベルからの発光であるが、522nmの緑

色発光はそれよりもエネルギーが 500 cm⁻¹ 程度高い ³P₁レベルからの発光である.³P₀と ³P₁は熱的に結合し ているため,高温下では ³P₁の分布が増え緑色の蛍光 強度が増加したと考えられる.また,200K以下の低温 ではこの蛍光が全く観測されなくなることも確認して いる.

300K 及び 380K における赤色発光の寿命はそれぞれ 38µs, 37µs であった. 20K における蛍光寿命は 49µs であったが, 200K から 380K の間では蛍光寿命が大き く変化することはなかった.



Fig. 4 (a) π -polarization and (b) σ -polarization emission spectra of the Pr:LiYF₄ crystal pumped at the GaN laser diode at 300 and 380 K.

4 結論

本研究では、我々が知る限りでは、最も高出力で高 効率な GaN 系半導体レーザ励起の赤色 Pr:LiYF4 レー ザの発振に成功した.また、380K という高温下におい ても発振閾値 22mW という低閾値を実現し、スロープ 効率が悪くならないことも確認した.赤色レーザとし ては AlInGaP 系の半導体レーザがあるが、熱に弱いた め高温下での動作や高出力化が難しい.それに比べ、 GaN系の半導体は大電流密度駆動に対して堅固な材料であり,比較的高温な状態でも動作可能である.また, 今回の実験結果より, Pr:LiYF4 レーザは高温下でもパフォーマンスがほとんど落ちないため, GaN 半導体レ ーザ励起 Pr:LiYF4 レーザは,高温下で高出力・安定動 作が求められるディスプレイ用等の光源には非常に有 用であると言える. Pr:LiYF4 結晶は半導体レーザ励起 に対しては十分な吸収帯域を持つが,それほど広くないため,励起光の波長制御は重要である.

今後は,さらなる高出力・高効率化と共に,緑色, オレンジ色での発振,さらには波長変換による紫外 光発生を進めていく予定である.

References

- K. Itaya, H. Sugawara, G. Hatakoshi, J. Cryst. Growth, 138 (1994) 768.
- [2] X.P. Hu, X. Wang, Z. Yan, H.X. Li, J.L. He and S.N. Zhu, Appl. Phys. B, 86 (2007)265.
- [3] P. W. Binum, T. L. Boyd, M. A. Pessot, Opt. Lett., 21(1996)34.
- [4] T. Sandrock, T. Danger, E. Heumann, G. Huber and B. H. T. Chai, Appl. Phys. B, 58(1994) 149.
- [5] A. Richter, E. Heumann, E. Osiac, G. Huber, W. Seelert and A. Diening, Opt. Lett., 29 (2004) 2638.
- [6] A. Richter, N. Pavel, E. Heumann, G. Huber, D. Parisi, A. Toncelli, M. Tonelli, A. Diening, W. Seelert, Opt. Express, 14 (2006)3282.
- [7] S. C. Buchter, H. P. Jessen, OSA TOPS 19(1998)34.
- [8] A. A. Kaminskii, A. I. Lyashenko, N.P. Isaev, V. N. Karlov, V. L. Pavlovich, S. N. Bagayev, A. V. Butashin, L. E. Li, Quantum Electron., 28(1998) 187.
- [9] M. Malinowski, M. F. Joubert, B. Jacquier, Phys. Stat. Sol.(a), 140(1993)K49.
- [10] T. Danger, A. Bleckmann and G. Huber, Appl. Phys., B 58(1994) 413.
- [11] R. G. Smart, J.N. Carter, A.C. Tropper, D.C. Hanna, S.T. Davey, S.F. Carter and D. Szebesta, Opt. Comm., 86(1991) 337.
- [12] A. Richter, H. Scheife, E. Heumann, G. Huber, W. Seelert, A. Diening, Electron. Lett.,41(2005)794.
- [13] J. M. Sutherland, P. M. W. French, J.R. Taylor and B.
 H. T. Chai, Opt. Lett., 29(1996) 797.